**國立中山大學半導體及重點科技學院半導體聯合實驗室**

**奈米級金屬氧化物薄膜共濺鍍熱處理系統委託代工申請單**

**委託者姓名：**  **指導教授(單位主管)：**

**電話：**  **手機：**  **E-mail：**

**使用單位：**

**聯絡地址：**

**製程需求：**□ O2 clean □ RF sputter □ HiPIMS

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 製程順序 | 使用製程 | 鍍膜材料 | 鍍膜厚度 | O2 clean時間 | 備註 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

 □RTA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 製程順序 | 升溫速率 (1~80°C/s) | 製程溫度(Max 1000°C) | 持溫時間 | 備註 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 結構圖： |
| 注意事項： |
| 委託日期時段： 月 日 時 分 ~ 時 分 | 試片數： |
| 委託代工技術服務費：新台幣 元整 |

儀器管理人員簽章： 收件人簽章： (取件)

儀器管理人：賴永裕先生 電話：07-5252000#6635 E-mail：laiyy@mail.nsysu.edu.tw